

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成21年6月18日(2009.6.18)

【公開番号】特開2008-19458(P2008-19458A)

【公開日】平成20年1月31日(2008.1.31)

【年通号数】公開・登録公報2008-004

【出願番号】特願2006-190097(P2006-190097)

【国際特許分類】

C 2 3 C 14/14 (2006.01)

C 2 3 C 14/24 (2006.01)

H 0 1 M 4/04 (2006.01)

H 0 1 M 4/40 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 14/14 D

C 2 3 C 14/24 D

H 0 1 M 4/04 Z

H 0 1 M 4/40

【手続補正書】

【提出日】平成21年4月20日(2009.4.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

リチウムまたはリチウム合金の気体粒子を生成する気体粒子生成部と、

前記気体粒子生成部で生成されたリチウムまたはリチウム合金の気体粒子から基材上にリチウム金属またはリチウム合金の膜を成膜する成膜部と、

前記気体粒子生成部に、リチウム金属またはリチウム合金のワイヤを供給するための供給部と、

少なくとも表面部が高分子樹脂を主成分とする材料によって構成され、前記供給部から前記気体粒子生成部まで前記ワイヤを送るためのロール部材と、  
を備えている、成膜装置。

【請求項2】

請求項1記載の成膜装置において、

前記ロール部材の少なくともフランジ部の全体が、前記高分子樹脂を主成分とする材料によって構成されている、成膜装置。

【請求項3】

請求項1または2記載の成膜装置において、

前記高分子樹脂は、ポリプロピレン、ポリエチレンおよびポリエチレンテレフタレートから選ばれる少なくとも1つの材料を主成分とする材料によって構成されている、成膜装置。

【請求項4】

請求項1～3のいずれかに記載の成膜装置において、

前記高分子樹脂を主成分とする材料は、無機フィラーを含有している、成膜装置。

【請求項5】

請求項1～4のいずれかに記載の成膜装置において、

前記成膜部は、シート状の基材を連続的に送る機構を有している、成膜装置。

【請求項 6】

請求項 1 ~ 5 のいずれかに記載の成膜装置を用いて基材上に成膜する成膜方法。